DERWENT-ACC-NO:

1996-399577

DERWENT-WEEK:

199640

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Edge face reflection type surface wave appts e.g. band pass filter, oscillator used in communication appts. - has reflection type surface wave element provided between opposite edge faces, on innerside surface of first and second slots which are formed on piezo electric substrate

PATENT-ASSIGNEE: MURATA MFG CO LTD[MURA]

PRIORITY-DATA: 1995JP-0003822 (January 13, 1995)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE JP 08195644 A July 30, 1996 LANGUAGE PAGES MAIN-IPC N/A 009 H03H 009/25

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DE JP 08195644A N/A

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO N/A 1995IP-0003822 APPL-DATE January 13, 1995

INT-CL (IPC): H03H003/08, H03H009/25

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08195644A

BASIC-ABSTRACT:

The appts has a piezo electric substrate (22) provided with a first slot (26) and a second slot (27) which are arranged parallel to each other on the upper surface. An internal digital transducer is formed on the upper surface of the piezo electric substrate, in between the first and the second slots. A reflection type surface wave element is formed between the two opposite edge faces, on the innerside surface of the first and the second slots.

A pair of non exciting parts are formed individually on the outerside of the first and the second slots. A cavity (35) is formed to expose the excitation part of the surface wave element. An armour resin layer (36) is provided to

cover the circumference of the piczo electric substrate. An electric connection member (33) is connected electrically to the surface wave element.

ADVANTAGE - Ensures reliable exposure of excitation part of surface wave element. Prevents deterioration in resonance characteristics. Enables to obtain desirable transmission characteristics.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/9

TITLE-TERMS: EDGE FACE REFLECT TYPE SURFACE WAVE APPARATUS BAND PASS FILTER

OSCILLATOR COMMUNICATE APPARATUS REFLECT TYPE SURFACE WAVE ELEMENT

OPPOSED EDGE FACE SURFACE FIRST SECOND SLOT FORMING PIEZO ELECTRIC

SUBSTRATE

DERWENT-CLASS: U14 U23 V06

EPI-CODES: U14-G; U23-A01A; V06-K02; V06-K08;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-336856

PAT-NO:

JP408195644A

DOCUMENT-IDENTIFIER: IP 08195644 A

TITLE

END SURFACE REFLECTION TYPE SURFACE WAVE DEVICE

AND ITS

MANUFACTURE

PUBN-DATE:

July 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION: NAME TAKAKUWA, YASUTOKU HAYASHI, MASATAKE MOROZUMI, KAZUHIKO KADOTA, MICHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MURATA MEG CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP07003822

APPL-DATE: January 13, 1995

INT-CL (IPC): H03H009/25, H03H003/08

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an end surface reflection type surface wave device which hardly causes damping owing to the sticking of package resin and then obtains transmission characteristics as desired, and utilizes an SH type surface wave.

CONSTITUTION: On the top surface of a piczoelectric substrate 22, 1st and 2nd grooves 26 and 27 are formed and an IDT is formed on the top surface between the 1st and 2nd grooves 26 and 27 to constitute an end surface

reflection type surface wave element part having two opposite end surfaces as the internal surfaces 26a and 27a of the grooves 26 and 27. Nonexcitation parts 28 and 29 are formed outside the 1st and 2nd grooves 26 and 27, a cavity 35 is formed so as to securely expose the excitation part 37 of a surface wave element to the cavity 35, and the periphery is covered with a package resin layer 36.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出職公開番号 特期平8-195644

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日

(51) Int.Cl.*		識別記号	广内整理番号	FΙ	技術表示箇所
HO3H	9/25	A	7259-5 J		
	3/08		7259-5 J		

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 E)

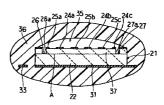
(21)出顯書号	特顧平7 -3822	(71)出版人 000006231
		株式会社村田製作所
(22) 出顧日	平成7年(1995)1月13日	京都府長阿京市天神二丁目26番10号
		(72)発明者 高桑 泰徳
		京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
		会社村田製作所内
		(72)発明者 林 誠順
		京都府長阿京市天神二丁目26番10号 株式
		会社村田製作所内
		(72)発明者 勝角 和彦
		京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
		会社村田製作所内
		(74)代理人 弁理士 宮▼崎▲ 主税 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 端面反射型表面波装置及びその製造方法

(57)【現約】

【目的】 外装側指の付着によりダンビングが生じ難 く、従って所望通りの伝送特性を得ることを可能とする SHタイプの表面波を利用した端面反射型表面波装置を 得る。

【構成】 圧電基板22の上面に互いに平行に第1,第 2の溝26,27を形成し、第1,第2の溝26,27 間において上面にIDT23を形成することにより、溝 26,27の内面26a,27aが対向2端面とされた 端面反射型表面波素子部を構成してなり、第1,第2の 滑26,27の外側に非肺臓器28,20分脈炎されて おり、表面波素子の肺脹部37が空洞35に電実に臨む ように空消35が形成されており、周囲が外裏側脂層3 6で置われている端面反射型を加速装置。



【特許請求の範囲】

1 【請求項1】 SHタイプの表面波を利用した表面波装 置であって、

内側の面同士が平行となるように一方主面側から形成さ れた第1、第2の溝を有する圧電基板と、

前記圧電券板の第1、第2の漢間に挟まれた基板部分に 形成された少なくとも1つのインターデジタルトランス デューサとを備え、

前記第1,第2の溝の内側の面が対向2端面を形成して おり、かつ前記圧電基板の第1、第2の溝の外側の部分 が非励振部とされており、

前記表面波素子の励振部を露出させるための空洞を残し て、前記圧電基板の周囲を被覆している外装樹脂層と、 前記表面波素子に電気的に接続されており、かつ前記外 装樹脂層外に引き出された電気的接続部材とをさらに備 える、端面反射型表面波装置。

【請求項2】 前記空洞に露出される部分が、第1,第 2の溝間の圧電基板部分の前記インターデジタルトラン スデューサが形成されている側の一方主面と、該一方主 20 面からSIIタイプの表面波の波長の3倍までの深さに至 る端面部分とである、請求項1に記載の端面反射型表面 波装置。

【請求項3】 圧電基板の一方主面において、励振部を 構成する部分に少なくとも1つのインターデジタルトラ ンスデューサを形成する工程と、

前記圧電基板の一方主面から励振部を挟んで、かつ各内 面同士が平行となるように第1,第2の溝を形成する工 程と

サに接続される電気的接続部材を配置する工程と、 少なくとも励振部を署うように前記圧電基板にワックス を付与する「程と

前記ワックス付与後に、前記電気的接続器材が引き出さ れている部分を除く全体を熱硬化性樹脂により被覆する 工程と、

加熱により前記ワックスを飛散させて空洞を形成すると ともに、前記熱硬化性樹脂を硬化させ、外装樹脂層を形 成する工程とを備える、請求項1に記載の端面反射型表 面波装置の製造方法。

【請求項4】 前記ワックスを付与する部分が、第1. 第2の溝間の圧電基板部分の前記インターデジタルトラ ンスデューサが形成されている一方主面と、前記一方主 而から励揚されるSHタイプの表面波の波形の3倍まで の深さに至る端面部分とである、請求項3に記載の端面 反射型表面波装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、BGS波やラブ波など のようなSHタイプの表面波を利用した端面反射型の表 50 部分を露出させ、それによって熱硬化性樹脂が表面波伝

2 面波装置に関し、特に、樹脂外装が施された形式の端面 反射型表面波装置及びその製造方法に関する。

【〇〇〇2】本発明の端面反射型表面波装置は、例え ば、各種通信機器における帯域フィルタや発振子等に用 WAAA.

100031

【従来の技術】SHタイプの表面波とは、変位が表面波 伝搬方向と垂直な方向の成分を含む表面波を言い、BG S波やラブ波などが知られている。この種のSHタイプ 該対向 2 端面間に端面反射型の表面波素子が構成されて 10 の表面波は、端面において反射されたとしても、成分の 変化が生じ難い。従って、SHタイプの表面波を利用し た表面波装置とでは、対向2端面間で表面波を反射させ て共振特性を得る、いわゆる始而反射型表面波装置が提 案されている。端面反射型表面波装置では、対向2端面 間で表面波を反射させるものであるため、表面波伝機部 分の外側に余分な基板部分を必要としない。

> 【0004】すなわち、通常のレーリー波を利用した表 面波装置では、端面反射型表面波装置を構成することが できず、かつ表面波伝播領域の外側に反射器やダンピン

グ材を設ける必要があったため、表面波装置のサイズが 大きくなるという問題があったのに対し、SHタイプの 表面波を利用した端面反射型表面波装置では、上記のよ うな反射器やダンピング材を設ける必要がないため、表 面波装置を小型とすることができる。

【0005】他方、レーリー波を利用した通常の表面波 装置では、従来より、樹脂外装を施したリード付きの電 子部品として構成されたものやセラミックパッケージ内 に表面波素子チップを収納してなる部品等が種々実用化 されている。このうち、樹脂ディップにより外装を施し 前記少なくとも1つのインターデジタルトランスデュー 30 た従来の表面波装置を図1及び図2を参照して説明す

> 【0006】図1に示す表面波共振子1は、レーリー波 を利用した表面波共振子である。表面波共振子1は、矩 形の圧電基板2上に一対のくし歯電極からなるインター デジタルトランスデューサ(以下、IDT)3を形成し た構造を有する。IDT3の表面液伝搬方向の両側に は、反射器4、5が形成されている。

【0007】表面波共振子1を樹脂外装が施された電子 部品として構成する場合、IDT3をボンディングワイ ヤーによりリード端子(図示せず)に接続し、かつ表面 波基板2の上面にバラフィンワックスを塗布する。しか る後、リード端子の引き出されている部分を除き、残り の部分を熱硬化性樹脂により被覆し、加熱により該熱硬 化性樹脂を硬化させるとともに、図2に示す空洞6を形 成する。

【0008】図2は図1のHー日線に沿う部分に相当す る斯面図であり、空洞6は、熱硬化性樹脂よりなる外装 樹脂層7内に形成されており、表面波基板2の上面を露 出させている。空洞6は、表面波共振子1の表面波伝機

撮路上に接触することによる特性の劣化を防止する機能 を果たす。

【0009】上記のように、従来の表面波装置では、励 振面に外装樹脂が付着すると表面波がダンピングされる ため、パラフィンワックスを用いて空洞6が形成されて いた。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したレ ーリー波を利用した表面波装置1と同様にして、SHタ 外装を施した場合には、空洞を形成したにも関わらず、 所望の共振特性が得られないことがあった。

【0011】すなわち、端面反射型の表面波装置では、 パラフィンワックスの付与、熱硬化性樹脂ディップ、加 熱による空洞の形成及び熱硬化性樹脂の硬化といった一 連の工程を実施したとしても、空洞が形成されているに も関わらず、共振特性が大きく劣化することがあった。 【0012】本発明の目的は、SHタイプの表面波を利 用した端面反射型の表面波装置であって、共振特性の劣 化を防止するための空洞を形成して樹脂外装を施した場 20 合であっても、所望通りの特性を確実に得ることを可能 とする端面反射型表面波装置及びその製造方法を提供す ることにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した課題 を達成するためになされたものであり、SHタイプの表 面波を利用した表面波装置であって、内側の面同士が平 行となるように一方主面側から形成された第1、第2の 溝を有する圧電基板と、前記圧電基板の第1、第2の溝 間に挟まれた基板部分に形成された少なくとも1つのイ 30 に示した樹脂外装を施す前の表面波共振子11に比べ ンターデジタルトランスデューサとを備え、前記第1, 第2の溝の内側の面が対向2端面を形成して該対向2端 面間に端面反射型の表面波素子が構成されており、かつ 前記圧電基板の第1,第2の溝の外側の部分が非励振部 とされており、前記表面波索子の励振部を露出させるた めの空洞を残して、前記圧電基板の周囲を被覆している 外装樹脂層と、前記表面波素子に電気的に接続されてお り、かつ前記外装樹脂層外に引き出された電気的接続部 材とをさらに備える、端面反射型表面波装置である。

【0014】本願発明者らは、端面反射型表面波装置に 40 おいて、空洞を残して樹脂外装を施した場合に共振特性 が劣化する現象について種々検討した。すなわち、例え ば図3に示す端面反射型表面波共振子11を用い、樹脂 外装を施し、その共振特性を評価した。

【0015】図3に示す端面反射型表面波共振子11 は、BGS波を利用したものであり、P方向に分極処理 された矩形の圧電基板12を用いて構成されている。圧 電基板12の上面12aには、一対のくし情電極13、 14が形成されており、それによって1つのIDTが構 成されている。すなわち、くし歯電極13は、複数本の 50 【0021】よって、本発明では、圧電基板に上記第

4 電極指13a~13cを有し、くし歯電極14は複数木 の電極指14a~14cを有し、電極指13a~13c と、電極指14a~14cとは互いに間挿し合ってい

【0016】また、 両端の電極指14a及び13cを除 く残りの電極指の幅及び各電極指問の間隔は、 入/4と されている。ただし、入は、励振されるBGS波の波長 を示す。また、電極指14a, 13cの幅はA/8とさ れている。さらに、電極指14a, 13cは、それぞ イプの表面波を利用した端面反射型表面波共振子に樹脂 10 れ、端面12b,12cの上端に沿うように形成されて

> 【0017】端面反射型表面波共振子11では、くし歯 鉱極13、14から交流電圧を印加することによりBG S波が励振され、矢印X方向に伝搬し、端面12b.1 2cで反射され、共振する。

> 【0018】ところで、樹脂ディップにより外装樹脂層 を形成するにあたり、まず、図示しないリード端子をく し歯電極13、14にボンディングワイヤーにより接続 した後、上面12a上にパラフィンワックスを塗布す

る。しかる後、エポキシ樹脂を用いてリード端子の引き 出されている部分を除いて被覆し、加熱によりパラフィ ンワックスを飛散させて空洞を形成するとともに、外装 樹脂層を形成する。 すなわち、図4に断面図で示すよう に、端面反射型表面波共振子11の上面に空洞15を形 成し、空洞15を残すようにして、周囲を外装樹脂層1 6により被覆することにより、樹脂外装が練された表面 波装置を得る。なお、図4において、18、19はリー ド端子を示す。

【0019】ところが、この表面波装置17では、図3 て、共振特性の劣化が著しかった。そこで、本願発明者 らは、上記問題点を鋭意検討した結果、レーリー波を利 用した表面波装置とは異なり、SHタイプの表面波を利 用した表面波装置では、圧電基板の表面だけでなくある 程度の深さ部分においても表面波が伝搬するため、圧電 基板12の上面12a上のみを空洞15に露出させただ けでは、共振がダンピングされることを見出した。すな わち、図4に示す断面図において、一点鎖線Aで示す位 置より上方の圧電基板部分が励振に寄与しているため、 言い換えれば、励振部17Aが一点鎖線Aよりも上方の 部分全体となっているため、単に圧電基板12の上面1 2aのみを空洞15に露出させただけでは、共振がダン ピングされることを見出した。

【0020】そこで、励振部17Aの外装樹脂によるダ ンピングを防止するには、圧電基板12の上面12aだ けでなく、端面12b、12cの上方部分、すなわち励 振部17Aの端面12b、12cに露出している部分に ついても、外装樹脂の付着を防止する必要があると考え

5

1,第2の溝が形成されており、上記第1,第2の溝の 各内面が対向2端面とされており、この対向2端面の少 なくとも上方部分をも空洞に露出するように、外装樹脂 層が形成されている。

【0022】そして、本発明では、上記空洞の形成を容 易とするために、圧電基板に第1、第2の溝を形成し、 第1、第2の溝の外側に非励振部を設けておき、第1、 第2の溝の非励振部から励振部に至るようにパラフィン ワックスを塗布することにより、励振部を空洞に確実に 露出させることが可能とされている。

【0023】従って、木発明の端面反射型表面波装置で は、空洞形成に際して塗布されるパラフィンワックスが 第1、第2の漢内に容易に入り込み得るため、圧電基板 のIDTが形成されている部分だけでなく、対向2端面 の上方部分も確実に空洞に対して露出する。よって、樹 脂外装を施した端面反射型の表面波装置であるにも関わ らず、外装樹脂層によるダンピングが生じ難いため、共 振特性に優れた端面反射型表面波装置を提供することが 可能とされている。

【0024】また、上記励振部の深さは、通常、SHタ 20 イプの表面波は、振動成分が表面波の波長の3倍程度ま での深さ部分を進行するため、表面波の波長の3倍まで の深さとなっている。従って、好ましくは、上記空洞に 露出される部分は、第1、第2の溝間の圧電基板部分の IDTが形成される一方主面と、該一方主面からSHタ イプの表面波の波長の3倍までの深さに至る端面部分と され、それによって確実に励振部が空洞に露出されるこ とになる.

【0025】また、本発明の製造方法は、上記本発明の 端面反射型表面波装置を得るための方法であり、圧電基 30 板の一方主面において、励振部を構成する部分に少なく とも1つのIDTを形成する工程と、前記圧電差板の一 方主面から励振部を挟んで、かつ各内面同士が平行とな るように第1,第2の溝を形成する工程と、前記少なく とも1つのIDTに接続される電気的接続部材を配置す る工程と、少なくとも励振部を覆うように前記圧電基板 にワックスを付与する工程と、前記ワックス付与後に、 前記電気的接続部材が引き出されている部分を除く全体 を熱硬化性樹脂により被覆する工程と、加熱により前記 ワックスを飛散させて空洞を形成するとともに、前記熱 40 硬化性樹脂を硬化させ、外装樹脂層を形成する工程とを 備える。

【0026】なお、本発明の製造方法においては、上記 IDTを形成する工程と、第1,第2の溝を圧電基板に 形成する工程は、何れが先に実施されてもよい。何れに しても、少なくとも1つのIDTが形成されており、か つIDTが形成されている励振部を挟むように第1、第 2の溝が形成された圧電基板が用意され、しかる後 I D Tに電気的接続部材が接続される。そして、少なくとも 励展部を覆うようにワックスが付与され、さらに電気的 50 面反射型表面波装置では、対向2端面間で励振部を構成

6 接続部材の引き出されている部分を除いた残りの部分が 然硬化性樹脂により被覆され、加熱により熱硬化性樹脂 が硬化されて外装樹脂層が形成されるとともに、上記ワ ックスが飛散されて空洞が形成される。

【0027】従って、従来のレーリー波を利用した表面 波装置の場合と同様に、樹脂外装が練された表面波装置 を容易に得ることができる。しかも、パラフィンワック スが、上記励振部を露出させるように付与されているた め、共振特性の劣化が生じ難い、本発明の端面反射型表 10 面波装置を提供し得る。

【0028】また、本発明の製造方法においては、好ま しくは、上記ワックスの塗布が、第1,第2の溝間の圧 獣基板部分のIDTが形成されている一方主面と、該一 方主面からSHタイプの表面波の波長の3倍までの深さ に至る端面部分とに行われ、それによって励振部分が空 洞に確実に露出されることになる。

【0029】なお、上記ワックスとしては、外装樹脂を 加熱により硬化させる際に、飛散し空洞を形成し得る限 り、適宜の材料、例えばバラフィンワックスを用いるこ とができる.

【0030】また、熱硬化性樹脂についても、上記ワッ クスを飛散させて空洞を形成した後に適度な硬度を有す るように硬化される適当な熱硬化性樹脂を用いることが でき、特に限定されるものではない。

【0031】さらに、上記電気的接続部材については、 樹脂外装が練された電子部品に用いられている適宜のリ ード線やリード端子を用いることができ、特に限定され るものではない。

【0032】なお、上記圧電基板に第1,第2の溝を形 成する工程は、圧電基板の一方主面側から例えばダイサ 一や切断刃を用いて溝加工することにより行ない得る が、この場合、形成される溝の幅が、表面波のエネルギ 一が入り込み得る以上の大きさとすることが必要であ り、このような溝の幅は、例えば、ダイサーのブレード の厚みを調整することにより容易にコントロールするこ とができる. [0033]

【発明の作用及び効果】上記のように、本発明の端面反 射型表面波装置では、圧電基板に第1,第2の溝が形成 されており、該圧電基板の第1、第2の溝間に端面反射 型表面波素子が構成されている。そして、第1、第2の 溝の外側の部分に上記非励振部が構成されているため、 空洞を形成のためのワックスなどを励振部を確実に露出 させるように付与することができる。そのため、本発明 の端面反射型表面波装置では、空洞に、表面波共振素子 の励振部が確実に露出されている。

【0034】よって、SHタイプの表面波を利用した端 面反射型表面波装置であって、所望通りの特件を実現し 得る装置を確実に提供することが可能となる。なお、端 されているので、表面波装置の小型化を促進し得るが、 本発明の端面反射型表面波装置では、第1、第2の溝の 外側に非励振部が設けられており、その非励振部の分だ け表面波装置のサイズが大型化する。しかしながら、非 励振部は励振部を空洞に確実に露出させるように、すな わちワックスの塗布領域を拡げるために設けられている ものに過ぎず、従って、非励振部は、さほど大きくする 必要はない。よって、非励振部が設けられるにしても、 非励振部をさほど大きくする必要がないため、従来の端 面反射型ではない表面波装置に比べれば、表面波装置の 10 サイズを小型化し得る。

7

【0035】また、本発明の表面波装置の製造方法で は、上記のように、第1、第2の連環の圧電拡板部分に 少なくとも1つのIDTが形成した構造を得た後に、少 なくとも励振部を覆うようにワックスが付与される。こ の場合、第1、第2の溝の外側に非励振部が設けられて いるため、ワックス付与に際し、確実に励振部を覆うよ うにワックスを付与することができる。よって、励振部 が露出されている空洞を確実に外装樹脂層内に形成する ことができる。従って、従って、従来のレーリー波を利 20 用した表面波装置の場合と同様に、樹脂外装が施された 表面波装置を容易に得ることができる。しかも、パラフ ィンワックスが、上記励振部を露出させるように付与さ れているため、上述した本発明の端面反射型表面波装置 と同様に、共振特性の劣化が生じ難い、樹脂外装が施さ れた端面反射型表面波装置を提供し得る。

[0036]

【実施例の説明】以下、BGS波を利用した端面反射型 表面波共振子に応用した表面波装置についての実施例に

【0037】まず、図5に示されている肝臓基板22を 用意する。圧電基板22としては、チタン酸ジルコン酸 鉛などの圧電セラミックス、LiTaO: もしくはLi NbOa 、水晶などの圧電単結晶からなるものを用いる ことができる。

【0038】次に、上記圧電基板22の上面に、A1な どの金属材料をスパッタリングすることにより、A1膜 を形成する。しかる後、フォトリソグラフィーによりA 1膜をパターニングし、IDT23を形成する。IDT 23は、一対のくし歯電極24、25を有する。くし歯 40 電極24,25は、それぞれ、複数本の電極指24a~ 24c, 25a~25cを有する。複数本の電極指24 a~24cと、複数本の電極指25a~25cとは互い に間挿しあうように配置されている。

【0039】次に、圧電基板22の上面からダイシング マシーンにより所定の幅の第1、第2の溝26、27を 形成する。上記溝26,27の形成と、IDT23の形 成は逆に行ってもよい。すなわち、まず溝26,27を 形成した後に、1DT23を形成してもよい。

歯電棒24、25の電棒指24a~24c、25a~2 5 c の うち、 両端の電極指 2 4 c , 2 5 a の幅は、他の 電極指の半分の幅、すなわち入/8とされている。ま た。残りの電極指24a、24b、25b、25cの幅 は、 入/4の幅とされている。従って、全てが入/4の 幅の複数本の電極指を有する一対のくし歯電極を形成し た後に、上記漢26、27を形成するに際し、両端の電 極指の幅を1/2に分割するように満26、27を形成 することにより、上記IDT23を正確に形成すること ができる。すなわち、両端の電極指24c, 25aの外

(構造録が満26、27の内面26a、27aに正確に臨 むように確実にIDT23を形成することができるの で、先にIDT23を形成した後に、満26、27を形 成することが望ましい。

【0041】溝26、27の内面26a、27aは、互 いに平行とされており、従って端面反射型表面波素子に おける対向2端面を構成している。上記のように溝2 6、27を形成することにより、溝26、27間に端面 反射型表面波素子部分が構成されるとともに、漢26. 27の外側には、非励振部28、29が構成されること

になる。

【0042】次に、図5に示した表面波素子チップ21 を、図6に示すように、第1の金属端子31上に接着剤 を用いて接着する。他方、第1の金属端子31と一方の くし歯眩傷24とをボンディングワイヤー32により提 続する。さらに、1字状の第2の金属端子33を金属端 子31の側方に配置し、金属端子33と、他方のくし歯 電極25とをボンディングワイヤー34により接続す

30 【0043】なお、金属端子31,33は、本発明の電 気的接続部材を構成するものであるが、電気的接続材 は、図6に示した金属端子31、33に限らず、金属線 などにより構成してもよい。もっとも、金属端子31の ように、表面波素子21を載置し得る大きさを有する素 子裁置部31 aが形成された平板状の金属端子を用いる ことが望ましい。

【0044】次に、図5に一点鎖線30で示す領域にパ ラフィンワックスを付与し、しかる後、エポキシ樹脂な どの熱硬化性樹脂で周囲を被覆する。この場合、熱硬化 性樹脂を溶融状態に保っておき、溶融状態の熱硬化性樹 脂にワックスが塗布された表面波素子21を浸漬し、さ らに引き上げることにより、上記熱硬化性樹脂よりなる 被覆を形成することができる。

【0045】しかる後、熱硬化性樹脂が硬化する温度ま で加熱することにより、例えば150℃程度の温度で熱 処理を加えることにより、 熱硬化性樹脂からなる外誌樹 脂層を硬化させる。この場合、加熱により、塗布されて いたパラフィンワックスが飛散し、内部には空洞が形成 される.

【0040】もっとも、IDT23を構成しているくし 50 【0046】すなわち、図7に断面図で示すように、表

チップ21を得た。

α

面波素子チップ21の上方に空洞35が形成され、かつ 全体が外装樹脂層36で被覆されたリード付き電子部品 が得られる。

【0047】ところで 本実練例では 空漏35は 第 1、第2の溝26、27間で挟まれた表面波素子部分の 励振部37を確実に露出するように形成されている。す なわち、図5から明らかなように、パラフィンワックス は、非励振部28、29の上面にまで至るように付与さ れる。従って、第1、第2の溝26、27間の圧電基板 る第1、第2の溝26、27の内面26 a、27 a も空 洞35に確実に鑑出されることになる。よって、図7に 示した本実施例の場面反射型表面波装置38では 図7 の一点箱線Aで示す部分よりも上方に配置されている励 振部37が、確実に空洞35に露出されることになる。 【0048】従って、外装樹脂36を設けたリード付き の電子部品として構成した場合であっても、共振特性の 劣化が生じ難い端面反射型の表面波装置を提供すること ができる.

【0049】次に、具体的な実験例に基づき、本発明の 20 効果を明らかにする。上記圧電基板として、PZTから なり、厚み500 mmの圧電基板を用意した。次に、厚 み1μmのA1電極をスパッタリングにより上面の全面 に形成した。しかる後、フォトリソグラフィーによりA 1電極をパターニングし、上記 IDT23を形成した。 なお、励振されるBGS波の波長が82μmとなるよう に、かつ電極指交差幅が228 mm、電極指の対数が2 Oとなるように上記IDT23を形成した。

【0050】しかる後、ダイシングマシーンを用い、3 2の溝26、27を形成した。第1、第2の溝26、2 7の外側には、幅方向、すなわち、表面波伝搬方向に沿

う方向の寸法が約200umの非隣陽部28、29を残*

10 * すように、圧電基板を切断し、図5に示した表面波素子

【0051】次に、図5に示した一点鎖線30で示した 領域にパラフィンワックスを該圧電基板の1/2の厚み に付与し、しかる後全体を熱硬化性樹脂で被覆し、加熱 により樹脂外装の形成及び空洞の形成を行った。

【0052】比較のために、上述した表面波案子チップ 21の内面26a,27a部分で切断し、非励振部2 8.29が設けられていない端面反射型の表面波素子チ

部分22aの上面だけでなく、対向2端面を構成してい 10 ップを得、上記実施例と同様にして金属端子の接合及び 樹脂外装の形成を行った。もっとも、この比較例では、 パラフィンワックスは、IDT23が形成されている圧 電基板部分の上面にのみに塗布した。

> 【0053】上記実施例及び比較例の表面波装置を50 個ずつ抜き取り、インピーダンス特性及び位相特性を測 定した。実施例及び比較例の表面波装置のインピーダン ス特件及び位相特性を図8に示す。

【0054】上記50個の実施例の表面波装置では、そ の全てが、図8の実練B、Cで示すインピーダンス特件 及び位相特性を示した。これに対し、比較例の表面波装 置では、実線B、Cで示すインピーダンス特性及び位相 特性を示したものが5~6個であり、ほとんどの表面波 装置において、破線D、Eで示すインピーダンス特性及 び位相特性を示すことが認められた。すなわち、比較例 の表面波装置に比べて実施例の表面波装置では、山谷比 (すなわち、反共振点におけるインピーダンス値の共振 点におけるインピーダンス値に対する比) が大きく、か つ位相回転角の大きいことがわかる。

【0055】上記実施例及び比較例の山谷比及び最大位 00μmの深さを有し、かつ100μmの幅の第1,第 30 相回転角を、機械的品質係数Qmとともに下記の表1に 示す。

[0056]

[表1]

	10110	AMP DOT DE CALL					
1			山谷比	最大位相回転角	機械的品質係數		
1			(dB)	(*)	Qm		
比	較	69	38.6	69.0	3 1 0		
実	潍	64	47. 9	79.9	675		

【0057】なお、表1に示した値は、実施例及び比較 例の表面波装置50個の平均値を示す。表1から明らか なように、実施例の表面波装置では、比較例の表面波装 置に比べて山谷比で約10dB、位相回転角で約10 機械的品質係数Omで2倍以上高められることが わかる。

【0058】また、図8の実線B、Cで示す特性を示す 実施例の表面波装置を抜き取り、表面波伝搬方向に沿っ て切断し、内部を観察したところ、空洞が励振部を確実※50 止は皆無であった。これに対し、破線D, Fの特性を示

※に認出するように構成されていたことが認められた。こ れに対して、破線D、Eで示す特性の比較例の表面波装 置では、空洞の形成が十分ではなく、くし歯電極の両端 近傍及び対向2端面の上方部分に熱硬化性樹脂が接触し ていることが確かめられた。

【0059】また、実線B、Cで示す特性を示した実施 例の表面波装置を30MHzの発信周波数の発振子とし て、発信回路に組み込んで評価した。その結果、発信停 1.1

した比較例の表面波装置を同様に発信回路に組み込んだ ところ、半数以上の表面波装置において発信停止が起こ った。

【0060】図9は、木発明の第2の実施例にかかる端 面反射型表面波装置を説明するための斜視図である。第 1の実施例では、1個のIDTが構成された端面反射型 表面波共振子に適用した実施例を説明したが、本発明 は、2以上のIDTが形成されている端面反射型表面波 装置にも適用することができる。

【0061】図9に示す第2の実施例は、2個の1DT 10 42、43を有する端面反射型のトランスパーサル型表 面波フィルタである。表面波素子チップ41では、1D T42,43が表面波伝搬方向に沿って所定距離を隔て て形成されている。圧電基板44では、上面から第1. 第2の溝45、46が形成されており、該第1、第2の 溝45,46間において、上記IDT42,43が形成 されている。すなわち、第1,第2の溝45,46間 に、トランスバーサル型の表面波フィルタ素子が構成さ れている。なお、第1、第2の溝45、46の内面45 a, 46 aは、互いに平行とされており、従って対向2 20 21…表面波素子チップ 端面を構成している。

【0062】なお、圧電基板44は、図示の矢印ド方 向、すなわち電極指の延びる方向と平行に分極処理され ている。その他の点については、第1の実施例と同様で **ある**.

【0063】また、上記トランスパーサル型表面波フィ ルタに応用した表面波素子チップ41を用いて、第1の 実施例と同様に空洞が形成された外装樹脂層を有する表 面波装置を構成し、特性を測定した。さらに、比較のた めに、漢45.46の内面45a.46aの部分で切断 30 37…励振部 した素子チップを用いた、同様にしてリード付きの表面 波装置を構成し、特性を測定した。その結果、比較例の 表面波装置では、伝搬ロスが10dBであったに対し、 第2の実施例の表面波装置では伝搬ロスは5dBと、か

なり低減されることが確かめられた。

【図面の簡単な説明】

【図1】レーリー波を利用した従来の表面波共振子を説 明するための平面図。

12

【図2】図1に示した表面波共振子を用いた樹脂外装が 施された表面波装置の断面図.

【図3】従来の端面反射型表面波共振子を示す斜視図。 【図4】図3に示した端面反射型表面波共振子を用いて

構成された樹脂外装が施された表面波装置の横断面図。 【図5】第1の実施例で用意される表面波素子チップを 示す斜視図。

【図6】第1の実施例において、表面波素子チップを金 属端子上に載置した状態を示す斜視図。

【図7】第1の実施例の表面波装置の機断面図。

【図8】実施例及び比較例のインピーダンス特性及び位 相特性を説明するための図。

【図9】第2の実施例の表面波装置に用いられる端面反 射型の表面波素子チップを示す斜視図。

【符号の説明】

22…圧電基板 23...IDT

24.25…くし歯電板

26,27…第1,第2の溝

28, 29…非励振部

30…パラフィンワックスが塗布される領域

31,33…電気的接続部材としての金属端子

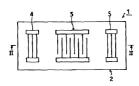
35…空洞 36…外装樹脂層

41…表面波素子チップ 42, 43 ··· IDT

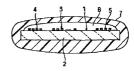
44…圧電基板

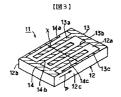
45,46…第1,第2の溝

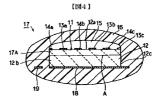
[271]

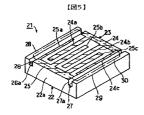


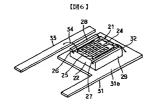
[図2]

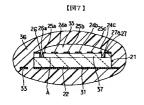


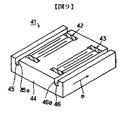


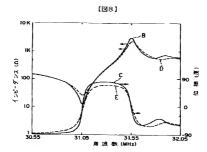












フロントページの続き

(72)発明者 門田 遊雄 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内